



**ÚSTAV INFORMATIKY**  
SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

**Pozývame Vás na**

## **SEMINÁR ÚI SAV,**

**ktorý sa bude konať v rámci medziakademickej dohody  
medzi SAV a BAV vo štvrtok 26.11.2015 o 14.00 hod.  
v zasadačke č. 102**

**Program:**

**Prof. Katia Zheleva VUTOVA**

Institute of Electronics, Bulgarian Academy of Sciences  
Sofia, Bulharsko

**Názov:**

**Simulácie parametrov procesu elektrónovej litografie pre energiu  
elektrónov 20, 30 a 40 keV**

**Anotácia**

Témou prednášky je simulácia procesu elektrónovej litografie a modelovanie expozície elektrónovým lúčom. Na simuláciu prieniku elektrónov v elektrónovom reziste a podložke sa využíva štatistická metóda Monte Carlo. Diskrétne dáta funkcie rozloženia energie sa porovnávajú s analytickou aproximáciou dvomi Gaussovskými funkciami. Výsledkom simulácií sú proximítné parametre rozptylu elektrónov, ktoré sa používajú vo výrobe elektronických obvodov.

**Tešíme sa na stretnutie s Vami pri šálke kávy alebo čaju.**

Ing. Ivana Budinská, PhD.  
riaditeľka